



República Federativa do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(22) Data de Depósito: 01/12/2005
(43) Data de Publicação: 25/09/2007
(RPI 1916)

(51) Int. Cl.:
G02B 6/42 (2007.01)

(54) Título: MÉTODO PARA FABRICAÇÃO DE DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS PARA LUZ POLARIZADA

(71) Depositante(s): Universidade Federal do Paraná (BR/PR)

(72) Inventor(es): Luciana Stolz Roman, Fabiano Thomaz

(57) Resumo: MÉTODO PARA FABRICAÇÃO DE DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS PARA LUZ POLARIZADA. Método para fabricação de dispositivos optoeletrônicos para luz polarizada e um trabalho enérgico para produzir um fotodetector baseado em materiais orgânicos, como polímeros e moléculas por exemplo. O processo é em primeiro momento depositar materiais orgânicos em solução clorofórmica, por exemplo, ou outro solvente orgânico, em um substrato plástico que anteriormente a deposição da solução polimérica recebe tratamento químico denominado alinhamento. Após a deposição e se a solução polimérica submeter-se o substrato plástico a um estiramento mecânico, que visa causar orientação do filme polimérico. O próximo é o da transferência do filme orientado do substrato plástico para substrato de vidro que já contém o primeiro eletrodo, podendo ser FT ou ITO. Coloca-se em contato o filme polimérico orientado com o su de vidro, em seguida aplica-se uma pressão mecânica sobre o lado do substrato plástico que contém o filme polimérico e além da pressão mecânica também é aplicado calor sobre o conjunto a fim de facilitar a transferência. Após o processo de transferência é removido o substrato plástico, já sem o filme orientado, e então é depositado por evaporação segundo contato metálico que pode ser ouro, alumínio ou cálcio.



FIGURAS

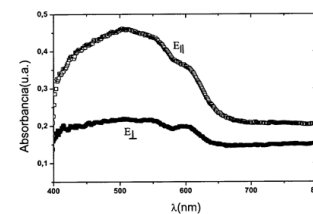
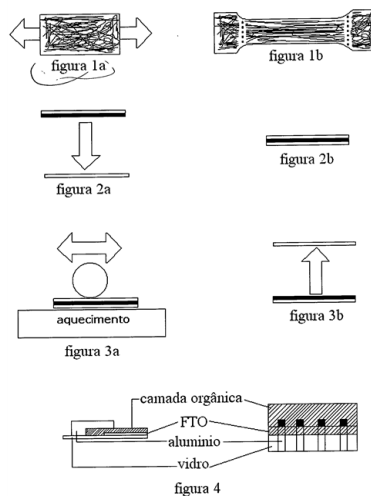


Fig. 5

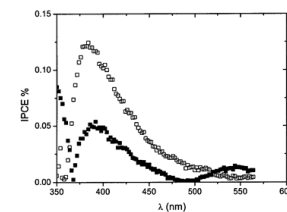


Fig 6